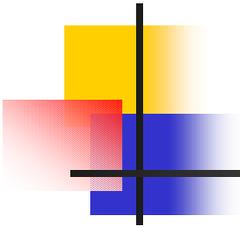


産業技術総合研究所における ベンチャー育成策

2003年3月31日

産業技術総合研究所

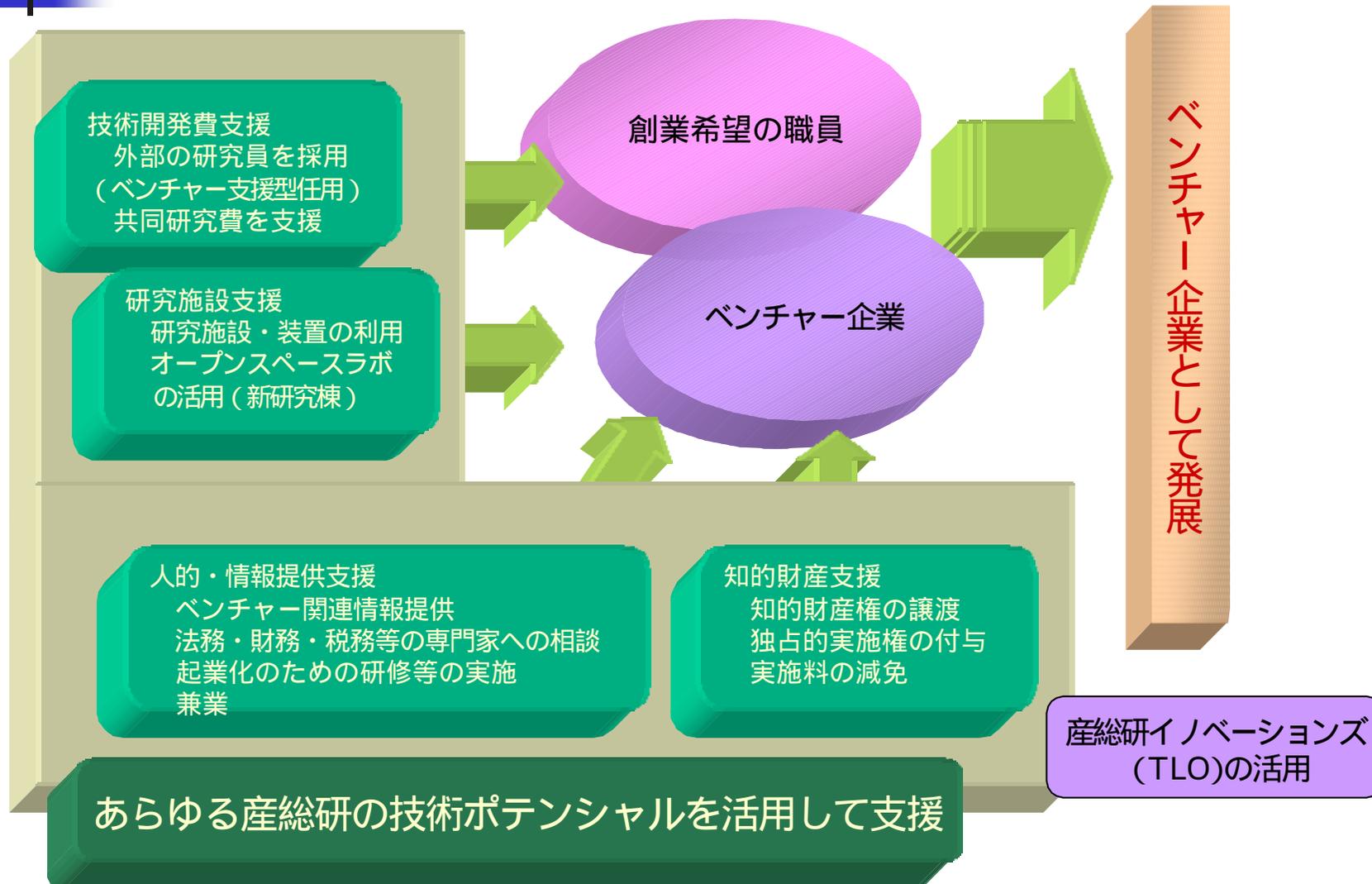


ベンチャー支援の目的

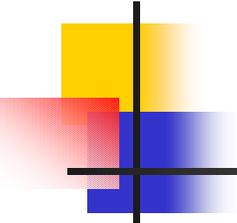
- 産総研で生まれた研究成果の富への転換 これによる新産業創造
 - ・ 既存企業への技術移転
 - パテントポリシー、技術移転ポリシー
 - 技術移転機関との連携
 - ・ベンチャー企業としてスピンオフ

- 産総研における先端研究促進とベンチャー創出の好循環の創出
 - ベンチャー企業等からの先端研究機器の調達

産総研におけるベンチャー支援



ベンチャー開発戦略研究センター



支援の状況

- 大学等外部機関の有する成果によるベンチャー創業支援（ベンチャー支援任用制度）
 - 14年度 3名の採用（前職はPD、大学助手）
 - うち1件は15年4月ベンチャー創業予定

- ライセンシング型共同研究（ベンチャー支援）
 - 14年度 8件採択
 - （例）毒素検知チップ
 - （株）イニシウム（1999年創業）
 - 先端バイオエレクトロニクス研究ラボ

産総研活用型ベンチャー支援の実績例

(平成14年9月現在)

中小企業支援型研究開発制度

技術シーズ持込評価型

	採択件数	実用化予定	実用化済
平成12年度	32	15	3
平成13年度	18	8	2
平成14年度	8	—	—

共同研究型

	採択件数	実用化予定	実用化済
平成12年度	9	3	1
平成13年度	15	2	0
平成14年度	8	—	—

ベンチャー企業からの調達

- 産総研における調達(500万円以上の研究関連機器の調達に関して)

合計		483件	57億円
内訳	一般競争入札	122件	17億円
	(うち中小企業	91件	10億円)
	随意契約	361件	41億円
	(うち中小企業	203件	21億円)
			(13年度)

- 共同研究等から派生する研究機器調達にあつては、一般競争原則の例外としての随意契約方式を活用。

具体例：顕微鏡観察皿温度制御装置 Onpu-4
(泰栄電器株式会社)

一般競争入札における措置

- 参加資格は4ランク
- ただし、入札物件と同等以上の製造実績があれば、ランクに無関係に入札に参加可能
(具体的には、プロトタイプがあれば製造実績があるとの判断をする取り組みを実施)
- 13年度500万円以上の研究関連機器の一般競争入札における実績(全体122件、17億円)
 - 下位ランクの者が落札した案件 19件 3億円
 - うちベンチャー企業 2件 25百万円(具体例) 予定価格Bランク、落札者Cランク
(株)エピックエスト(2000年設立) 酸化物CVD装置

今後必要な措置

- 研究関連機器の調達に関して、共同研究等の場合は随意契約を可能とすることの明示
 - ただし、職員が兼業しているベンチャーからの調達については、利益相反の可能性を考慮
- 研究関連機器の一般競争入札における下位ランクへの開放
- 公的研究機関(大学)における一般競争入札へのベンチャーの参加を促進する取り組み。特に
 - 資格要件の共有化(他の独法における実績に基づいて審査不要化)
 - 審査機関等による推薦書の発行(可能であれば、実績だけでなく、能力も審査)
 - その他調達希望機器を供給可能なベンチャー企業に関する情報の共有化